

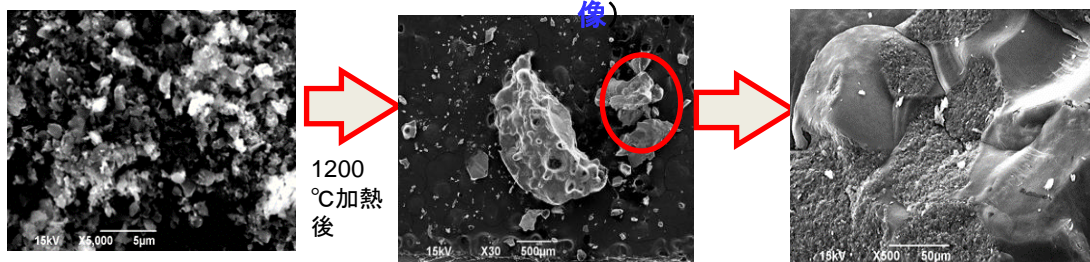
走査電子顕微鏡分析システム I



	顕微鏡部	分析装置部
設置 年度	2007年度	2004年度
型 式	JSM-6490	Genesis2000
製 造 所	日本電子	エダックスジャパン
仕 様	加速電圧 0.5, 1.0, 5.0, 10.0, 20.0KV 観察モード 二次電子像、反射電子像 倍率 5~5万倍 試料形状 粉体、構造体(φ25×H20mm以下)	検出器 エネルギー分散型 分析モード 線分析, 点分析, マッピング 検出元素: 酸素以上
用 途	塊状や粉状試料の表面観察や微構造観察などに広く利用できる。また、付帯の分析装置により、個体表面形状の観察部位の面分析・点分析・線分析さらには、元素マッピングが可能であり、使用後の耐火物などの解析にも役立ちます。	

事例紹介

炭化ほう素の粒子の状態(二次電子像)



炭化ホウ素原料の粒子は2~3μmで構成されているが、1200°C大気加熱後は一体の溶融物となっている

熱間圧縮試験用SiC押棒の各元素の元素マッピングを行った結果

